

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٠٢٤٣٣



دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فوتونیک

عنوان:

ساخت و اندازه‌گیری مقاومت مغناطیسی چند لایه‌های

ac glass/NiO/Co/Cu/Co/Ti و بررسی اثر بازپخت لیزری بر تغییرات مقاومت سیم آمورف کبالت-پایه

دانشجو:

فاطمه مطروodi

استاد راهنما:

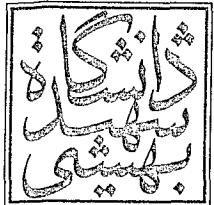
دکتر مجید قناعت شعار

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی طهرانچی

شهریور ۱۳۸۶

۱۰۲۴۲۳



دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ
شماره
پیوست

بسمه تعالیٰ

تهران ۱۱۳۱۹۸۳۹۶۳ اوین

«صور تجلیسه دفاع از پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد»

تلفن: ۲۹۹۰۱

بازگشت به مجوز دفاع شماره ۱۸۸۶ / ۲۰۰ / ۵ مورخ ۱۷/۶/۸۶ جلسه هیأت داوران ارزیابی پایان نامه خانم فاطمه مطروودی به شماره شناسنامه ۱۸۲ صادره از ها شهر متولد ۱۳۶۰ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فotonیک

با عنوان: ساخت و اندازه گیری مقاومت مغناطیسی چند لایه های glass/NiO/Co/Cu/Co/Ti آمورف کیالت - پایه

به راهنمایی: دکتر قناعت شعار

طبق دعوت قبلی در تاریخ ۱۷/۶/۸۶ تشکیل گردید و براساس رأی هیأت داوری و با عنایت به ماده ۲۰ آئین نامه کارشناسی ارشد مورخ ۲۵/۱۰/۷۵ پایان نامه مذبور با نمره ۸۵ و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

۱- استاد راهنمای: دکتر قناعت شعار

۱۳۸۷/۱/۲۱

۲- استاد مشاور: دکتر طهرانچی

۳- استاد داور: دکتر فیروز نیما

۴- استاد داور: دکتر توسلی

۵- نماینده تحصیلات تکمیلی پژوهشکده: دکتر نیکنام

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

تشکر و قدردانی :

الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم
الخبير

از خانواده‌ی عزیزم به خاطر حمایتهای بی‌درباره‌ی کمال سپاسگزاری را دارم و از استاد راهنمایی‌م جناب آقای دکتر قناعت‌شعار بواسطه‌ی زحمات و راهنمایی‌هایشان قدردانی می‌نمایم. از آقای محسنی و آقای مرادی به خاطر ارائه راهکارهای مفید تشکر می‌کنم. از تمامی دوستانم در آزمایشگاه مگنتوپتیک و پژوهشکده‌ی لیزر و پلاسما و تمام کسانی‌که به نحوی در انجام این پروژه با اینجانب همکاری داشته‌اند کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از دوستان بسیار عزیزم فاطمه صمادی، ایمان نجار، محبوبه آتشی، وحیده رمضانی و زهرا منصوری که با بودن در کنار آنها توانستم سختی‌های این دوره را پشت سر بگذارم بسیار سپاسگزارم.

چکیده

در این رساله به منظور ساخت دریچه‌اسپینی، چند لایه‌های مغناطیسی glass/NiO/Co/Cu/Co/Ti به روش تبخیر باریکه الکترونی، لایه نشانی شدند. در این ساختارها از اکسید نیکل برای افزایش و ادارندگی لایه کبالت مجاور آن استفاده شد. در هنگام لایه‌نشانی تعدادی از این ساختارهای مغناطیسی، به منظور ثابت‌سازی ممان‌های مغناطیسی در لایه کبالت مجاور با لایه اکسید نیکل، میدان مغناطیسی به‌وسیله دو عدد سیم پیچ اعمال شد. مقاومت مغناطیسی (MR) این ساختارها به روش چهار-اتصالی و با میدان مغناطیسی درون صفحه فیلم و در راستای جریان اندازه‌گیری شد. برای نمونه‌ای که در حضور میدان مغناطیسی لایه‌نشانی شد، حدود ۱۲٪ و برای نمونه‌ای که در شرایط مشابه اما بدون اعمال میدان مغناطیسی تهیه شد، حدود ۸٪ مقاومت مغناطیسی بسیار بزرگ (GMR) به دست آمد. در این دو نمونه، ضخامت چهار لایه متوالی Co/Cu/Co/Ti حدود ۱۵nm بود.

در بخش دیگر از این رساله، رفتار مقاومت ac سیم و نوار مغناطیسی آمورف کبالت-پایه در میدان مغناطیسی و نیز اثر بازپخت‌های لیزری بر آن بررسی شد. بازپختی که در آن جریان ثابت ۹mA به مدت ۱۰ دقیقه همراه با تابش لیزر پالسی Nd:YAG از نمونه عبور داده شد، اندازه تغییرات مقاومت ac در اثر اعمال میدان را افزایش داد. در حالی که بازپخت‌های لیزری بدون اعمال این جریان، اندازه MR متناوب را در نمونه اندکی کاهش داد.

کلمات کلیدی: مقاومت مغناطیسی، GMR، دریچه‌اسپینی، اکسیدنیکل/کبالت/مس/کبالت، لایه‌نشانی تبخیر باریکه الکترونی، سیم آمورف کبالت-پایه.

فهرست مطالب

۱	فصل اول: مقدمه.....
۴	فصل دوم: خواص مغناطیسی و مواد مغناطیسی نرم.....
۵	۲-۱- فرومغناطیس و پادفرومغناطیس.....
۱۰	۲-۲- خواص مغناطیسی مواد.....
۱۱	۲-۳- مواد مغناطیسی نرم
۱۲	۲-۳-۱- خواص مغناطیسی مواد مغناطیسی نرم
۱۲	۲-۳-۱-۱- تراوایی
۱۲	۲-۳-۱-۲- وادارندگی
۱۲	۲-۳-۱-۳- مغناطش اشبع
۱۳	۲-۳-۱-۴- اتلاف پسماند
۱۳	۲-۳-۱-۵- نشت انرژی و اتلاف توان.....
۱۳	۲-۳-۱-۶- اثر بارکاسین
۱۴	۲-۳-۲- مواد مغناطیسی نرم جدید.....
۱۴	۲-۳-۲-۱- مواد مغناطیسی نانوکریستالی
۱۴	۲-۳-۲-۲- مواد مغناطیسی مصنوعی
۱۴	۲-۳-۲-۳- نوارهای مغناطیسی آمورف
۱۵	۲-۳-۲-۴- سیم‌های مغناطیسی آمورف
۱۹	۲-۳-۳-۲- دیگر مواد مغناطیسی نرم نانوساختاری
۲۲	فصل سوم: مقاومت مغناطیسی
۲۲	۳-۱- مقاومت مغناطیسی معمولی (OMR)

۲۴	۲-۳- مقاومت مغناطیسی ناهمسانگرد (AMR)
۲۴	۳- مقاومت مغناطیسی تونل زنی (TMR)
۲۴	۴- مقاومت مغناطیسی فوق العاده بزرگ (CMR)
۲۵	۵- مقاومت مغناطیسی بسیار بزرگ (GMR)
۳۰	۱-۵- منشأ GMR
۳۲	۲-۵- رسانش وابسته به اسپین
۳۴	۳-۵- نقش ساختار نواری
۳۷	۴- مدل مقاومت
۴۱	۵- مروری بر کارهای انجام شده
۴۶	۶- بایاس تبادلی
۵۰	۷- دریچه اسپینی (SV)
۵۲	۸- آرایش‌ها و مواد مورد استفاده در ساختارهای دریچه اسپینی
۵۲	۹- ۱-۱- لایه فرومغناطیسی
۵۴	۱۰- ۱-۲- لایه فاصل
۵۴	۱۱- ۱-۳- لایه پادفرومغناطیسی
۵۵	۱۲- ۲-۷- شرایط رشد
۵۶	۱۳- ۳- جفت شدنگی مگنتواستاتیک
۵۷	۱۴- ۴- همبستگی بین ساختار حوزه و مقاومت مغناطیسی
۵۷	۱۵- ۵- اثر چگالی جریان
۵۸	۱۶- ۸- کاربردهای GMR
۵۸	۱۷- ۱- حافظه مغناطیسی با دسترسی تصادفی (MRAM)
۶۰	۱۸- ۲- حسگر میدان مغناطیسی
۶۳	فصل چهارم: امپدانس مغناطیسی و اندوکتانس مغناطیسی
۶۴	۱-۱- تعریف امپدانس مغناطیسی
۶۵	۲-۲- اثر پوسته
۶۵	۳-۳- اثر اندوکتانس مغناطیسی
۶۷	۴-۴- مروری بر کارهای انجام شده
۷۱	فصل پنجم: نتایج تجربی
۷۲	۱-۵- نتایج اندازه‌گیری روی نوار مغناطیسی : $Co_{68.15}Fe_{4.35}Si_{12.5}B_{15}$
۷۲	۲-۵- نتایج اندازه‌گیری روی سیم مغناطیسی آمورف : $Co_{68.15}Fe_{4.35}Si_{12.5}B_{15}$
۸۲	۳-۵- نتایج لایه‌نشانی فیلم‌های چندلایه و اندازه‌گیری مقاومت مغناطیسی

۱-۳-۵- فراهم کردن هدف برای لایه‌نشانی ۸۲	
۲-۳-۵- نحوه لایه‌نشانی ۸۳	
۳-۳-۵- روش اندازه‌گیری مقاومت مغناطیسی ۸۷	
۴-۳-۵- بررسی ساختار چنلاژهای ۸۹	
۵-۳-۵- نتایج اندازه‌گیری مقاومت مغناطیسی در چنلاژهای ۹۱	
۶-۴- نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات ۹۴	
مراجع ۹۶	

فهرست جداول‌ها

- ۴-۱. MR طولی و عرضی برای سیم آمورف Fe-Si-B در دمای اتاق [۶۷]. ۶۷
- ۴-۲. نتایج نسبت مقاومت ac برای سیم آمورف $\text{Co}_{68.15}\text{Fe}_{4.35}\text{Si}_{12.5}\text{B}_{15}$ در حالت خام و بعد از بازبینی. ۷۵
- ۴-۳. مشخصات لایه‌نشانی‌های انجام شده. ۸۵

فهرست شکل‌ها

- ۱-۱. (الف). نظم اسپینی موازی در یک ماده فرومغناطیسی. (ب) آرایش اسپینی پادموازی برای یک پادفرومغناطیس.....^۶
- ۲-۲. مثال‌هایی از آرایش‌های حوزه. (الف) یک تک حوزه با اندازه انرژی مگتواستاتیک بزرگ. (ب) انرژی مگتواستاتیک با تقسیم بلور به دو حوزه که مخالف هم مغناطیله هستند، نصف می‌شود. (ج) انرژی مگتواستاتیک با تقسیم به چهار حوزه به یک چهارم می‌رسد. (د) و (ه) نمونه، انرژی مگتواستاتیک صفر دارد. به این آرایش‌ها حوزه‌های بستاری گفته می‌شود.^۷
- ۳-۲. مثالی از حوزه‌هایی که مغناطش در مرز 180° تغییر می‌کند. (الف) یک دیواره نازک که موجب می‌شود انرژی ناهمسانگردی کمینه شود. (ب) یک دیواره ضخیم که در آن تغییر اسپین تدریجی است، و انرژی تبادلی را که تمایل دارد اسپین‌ها را موازی نگه دارد، کمینه می‌کند.^۸
- ۴-۲. نمایش تغییرات دیواره مغناطیسی. (الف) آرایش اولیه یک فرومغناطیس. (ب) و (ج) در حضور یک میدان اعمالی، حجم حوزه‌ها با جابجا شدن دیواره‌ها و چرخیدن، تغییر می‌کند. (د) در میدان‌های به حد کافی بزرگ، فرومغناطیس اشباع می‌شود. ^۹
- ۵-۲. مثالی از حلقه پسماند یک فرمغناطیس. میدان واحدندگی، H_{60} ، میدان مورد نیاز برای ایجاد مغناطش صفر در نمونه است. مغناطش پسماند، M_r ، مغناطش در میدان اعمالی صفر پس از آن که اشباع صورت گرفت، می‌باشد.^۹
- ۶-۲. ساختارهای حوزه مغناطیسی در سیم‌های آمورف دارای مگتونگش منفی و مثبت^{۱۷}
- ۷-۲. وابستگی منحنی‌های مغناطش به تنش در سیم‌های فلزی آمورف. اندیس‌های ۱-۶ به ترازهای مختلف تنش کششی اشاره دارند: (الف). برای ماده خام $\alpha_1 = 0^\circ$, $\alpha_2 = 83^\circ$, $\alpha_3 = 180^\circ$ Mpa و (ب). برای ماده بازیخت شده تنش/جریانی.^{۱۸}
- ۸-۲. مقایسه تراوایی‌های اولیه و مغناطش‌های اشباع مواد مغناطیسی نرم گوناگون.^{۲۰}

- ۱-۱. اندازه‌گیری مقاومت مغناطیسی عرضی. نمونه نشان داده شده ضریب هال منفی دارد. جهت H_y درون صفحه است و I_x جریان سیم پیچ مولد H_y می‌باشد [۲۲].
- ۱-۲. مثال‌هایی از مقاومت مغناطیسی ناهمسانگرد در فیلم‌های پلی‌کریستال Fe، Co، Ni₈₁Fe₁₉، Ni₅₀Co₅₀ و Ni₇₀Co₃₀.
- ۱-۳. خط‌های پر و نقاط به ترتیب مربوط به میدان مغناطیسی اعمالی موازی و عمود بر جریان و در صفحه نمونه می‌باشد. ضخامت فیلم‌ها تقریباً ۱۰۰ nm است [۲۴].
- ۲-۱. (الف): تغییر مقاومت چندلایه مغناطیسی به صورت تابعی از میدان مغناطیسی اعمالی. (ب): آرایش ممان‌ها (با پیکان نمایش داده شده است) در چندلایه (سه‌لایه) در میدان‌های مغناطیسی مختلف: در میدان صفر ممان‌ها به پادموازی هستند. وقتی میدان مغناطیسی خارجی H بزرگ‌تر از میدان مغناطیسی اشباع H_c می‌شود ممان‌ها موازی می‌شوند. (ج): منحنی مغناطش چندلایه [۲۹].
- ۲-۲. ساختارهای متنوعی که GMR در آن مشاهده می‌شود: (الف). چندلایه‌های مغناطیسی، (ب). شبه دریچه اسپینی، (ج).
- ۲-۳. دریچه اسپینی و (د). فیلم نازک دانه‌دار.
- ۳-۱. تراپرکترون در یک چندلایه که لایه‌های فرومغناطیسی متواالی آن مغناطش موازی (الف) و پادموازی (ب) دارند.
- ۳-۲. ساختارهای نوار الکترونی (چپ) و چگالی حالات (راست) Cu (الف) و Co_{fcc} برای الکترون‌های اسپین اکثیریت (ب) و اسپین اقلیت (ج).
- ۳-۳. مقاومت نرمال بر حسب میدان مغناطیسی برای تعدادی از چندلایه‌های Fe/Cr دارای جفت‌شدگی پادفرومغناطیسی در دمای K/۴. پیکان‌ها میدان اشباع H_c را نشان می‌دهند، میدانی که برای غلبه بر جفت‌شدگی پادفرومغناطیسی درون لایه‌ای میان لایه‌های Fe و هم‌جهت کردن مغناطش آنها لازم است [۲۶].
- ۳-۴. مقاومت مغناطیسی اشباع در K/۴ بر حسب ضخامت Cr در چندلایه‌های Si(111)/Cr(10nm)/[Fe(2nm)/Cr(t)]_NCr(5nm) دایره‌ها (N=۲۰) - ۱۲۵°C (N=۳۰) [۳۰].

- ۹-۳. حلقه‌های پسماند MOKE (الف) و مقاومت (ب) سه لایه Co/Au/Co که ضخامت 10 nm Co و ضخامت Au بین دو لایه 6 nm است، در دمای اتاق نشان داده شده است. دو فیلم Co میدان‌های پسماند مختلف دارند. بازه میدان مغناطیسی که مغناطش دو لایه Co پاد موازی و مقاومت کوچک است، با پیکان مشخص شده است [۳۱].
۱۰-۳. منحنی مغناطش (الف) و تغییر مقاومت متناظر با آن (ب) برای دریچه اسپینی
۱۱-۳. منحنی های مغناطش (الف) و تغییر مقاومت متناظر با آن (ب) برای دریچه اسپینی
۱۲-۳. توصیف تصویری مدل (M-B) (با ایاس تبادلی)
۱۳-۳. هندسه مدل (M-B) برای یک سیستم دارای بایاس تبادلی. توجه کنید که مغناطش زیرشبکه AFM دو جهت پادموازی
۱۴-۳. نمونه‌ای از حلقه‌های پسماند GMR در دریچه‌های اسپینی. نمودار (الف) میدان تبادلی، میدان و ادارندگی، و تغییر
۱۵-۳. نمایی از آرایش‌های مختلف دریچه اسپینی: (الف) SV فوقانی (ب) SV تحتانی و (ج) دوتایی.
۱۶-۳. نمودار مقاومت در مقابل جریان اعمالی برای المان‌های دریچه اسپینی $10\text{ }\mu\text{m} \times 30\text{ }\mu\text{m}$ با ساختارهای
Ta/NiFe/Co/Cu/Co/NiFe/MnNi/Ta نانومتر) و (Ta/NiFe/Cu/Co/NiFe/MnNi/Ta نانومتر) [۵۵].
۱۷-۳. نمایی از حالت‌های صفر و یک (الف) و (ب) [۵۶]. خط تشخیص و خط ثبت در المان حافظه (ج) [۵۷].
۱۸-۳. آرایش مقاومت‌های GMR در حسگر پل و تستون. متمنکرکننده‌های شار نشان داده شده‌اند: D1 و D2 به ترتیب
فاصله بین متمنکرکننده‌های شار و طول متمنکرکننده شار هستند.....
۶۱

- ۶۸ ۴-۱. مدار اندازه‌گیری v_L و Φ_θ ($= \int v_L dt$).
- ۷۲ ۵-۱. ساختار حوزه‌های مغناطیسی درون نوار مغناطیسی آمورف. در بخش درونی حوزه‌ها جهت‌گیری محوری دارند و در بخش خارجی، جهت‌گیری حوزه‌ها درون صفحه نوار و عمود بر طول نوار مغناطیسی است.
- ۷۳ ۵-۲. مدار مورد استفاده برای اندازه‌گیری MR در بایاس dc.
- ۷۳ ۵-۳. چیدمان اندازه‌گیری امپدانس مغناطیسی [۷۱].
- ۷۴ ۵-۴. نسبت مقاومت ac نمونه در فرکانس ۲۵۰ kHz بعد از بازپخت.
- ۷۶ ۵-۵. نمودارهای نسبت مقاومت ac سیم بعد از بازپخت اول. (الف) برای فرکانس ۱۰ Hz. (ب) فرکانس ۴۰ Hz. (ج) فرکانس ۶۰ Hz. (د) فرکانس ۱۰۰ Hz.
- ۷۷ ۵-۶. نمودار نسبت مقاومت ac سیم بعد از بازپخت دوم در فرکانس‌های: (الف). ۱۰، (ب). ۲۰، (ج). ۸۰ و (د) ۱۰۰ Hz.
- ۷۸ ۵-۷. نمودار نسبت مقاومت ac سیم بعد از بازپخت سوم. برای جریان ac با فرکانس (الف). ۱۰، (ب). ۲۰ Hz و (ج). ۴۰ Hz.
- ۸۰ ۵-۸. مدار پل وتسنون.
- ۸۲ ۵-۹. قرص کبالت و ریزدانه‌های تیتانیم درون بوته‌های گرافیتی آماده برای لایه‌نشانی به روش باریکه الکترونی.
- ۸۴ ۵-۱۰. نمایی از محفظه لایه‌نشانی.
- ۸۷ ۵-۱۱. دو روش اندازه‌گیری مقاومت نمونه: (الف) روش چهار اتصالی و (ب) روش دو اتصالی.
- ۱۳۳-۴ ۵-۱۲. تصویر نمونه‌های چندلایه با اتصالات الکتریکی برای اندازه‌گیری به روش چهار-اتصالی (الف). نمونه ۱۳۳-۳ با ترکیب NiO/Co/Cu/Co/Ti که در حضور میدان مغناطیسی درون صفحه لایه‌ها لایه‌نشانی شده است، (ب). نمونه ۱۳۳-۴ با ترکیب NiO/Co/Cu/Co/Ti و بدون اعمال میدان مغناطیسی لایه‌نشانی شده است، (ج). نمونه ۱۳۲-۷ با ترکیب NiO/Co/Cu/Co/Cu که در حضور میدان مغناطیسی درون صفحه لایه‌ها لایه‌نشانی شده است.
- ۸۸ ۵-۱۳. طیف XRD از نمونه ۱۳۳-۳. قله‌های بلوری اکسید نیکل با پیکان نشان داده شده‌اند.
- ۸۹ ۵-۱۴. طیف XRD از نمونه ۱۳۳-۴. قله‌های بلوری اکسید نیکل با پیکان نشان داده شده‌اند.

۱۴-۵. تصاویر AFM گرفته شده از نمونه ۳-۳. (الف) و (ب) سطح اکسید نیکل و (ج) و (د) سطح چند لایه.....	۹۰
۱۵-۵. ناهمواری‌های سطوح اکسید نیکل و چند لایه به ترتیب در (الف) و (ب) دیده می‌شود.	۹۰
۱۶-۵. منحنی (الف) مقاومت بر حسب میدان مغناطیسی. (ب) مقاومت مغناطیسی (MR) بر حسب میدان مغناطیسی برای نمونه ۴-۴.	۹۲
۱۷-۵. منحنی مقاومت مغناطیسی (MR) بر حسب میدان مغناطیسی برای نمونه ۳-۳.	۹۲
۱۸-۵. حلقه پسماند MOKE نمونه ۳-۳.	۹۳
۱۹-۵. نمودار رفت و برگشت مقاومت مغناطیسی نمونه ۳-۳.	۹۳

فصل اول

مقدمه

پس از پیشرفت تکنولوژی ساخت لایه‌های نازک و کشف اثر GMR (مقاومت مغناطیسی بسیار بزرگ)، استفاده‌های متنوعی از لایه‌های مغناطیسی شده است. امروزه لایه‌های نازک مغناطیسی اهمیت ویژه‌ای در صنایع پیشرفته از جمله الکترونیک، کامپیوتر و حسگرها دارند. ساختارهای GMR به دلیل تغییرات شدید مقاومت الکتریکی در میدان مغناطیسی و حساسیت بالا نسبت به میدان مغناطیسی، بیشتر مورد توجه می‌باشند. این ساختارها از دو بخش تشکیل می‌شوند، یک بخش مغناطیسی که از مواد فرومغناطیسی نظیر Fe, Co و Ni تشکیل می‌شود و بخش دیگر که شامل مواد غیرمغناطیسی مانند Ag, Cu و Au می‌باشد. برای بالا بردن میزان حساسیت نسبت به میدان مغناطیسی در ابعاد کوچک، ساختارهای GMR متفاوتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر کدام دارای مزايا و معایبی بودند. ساختار دریچه اسپینی از کاربردی‌ترین ساختارهای GMR است. این ساختار هم اکنون در هد خواندن دیسک سخت و حسگرهای میدان مغناطیسی استفاده می‌شود.

هدف از کار حاضر، ساخت لایه‌های مغناطیسی با پاسخ GMR قابل اندازه‌گیری است. از میان مواد مختلفی که در ساختارهای دریچه اسپینی به کار می‌روند، کبالت و مس به دلیل تطابق نواری خوب و پاسخ GMR نسبتاً بزرگ انتخاب شدند. برای اعمال بایاس تبدیلی از اکسیدنیکل استفاده شد که از مواد پادفرومغناطیسی با دمای نیل نسبتاً بالا و قابل استفاده در کاربردهای صنعتی است. نمونه‌ها به روش تبخیر باریکه الکترونی لایه‌نشانی شدند. برای بهبود اثر GMR لایه‌نشانی برخی از نمونه‌ها در حضور میدان مغناطیسی انجام شد.

فلزات آمورف در مقایسه با مواد نرم بلوری، رسانندگی الکتریکی و نیروی وادارندگی کوچکی دارند. از این رو اتلاف جریان ادی و اتلاف پسماند آنها کمتر است. کاربرد اصلی این مواد در سنسورهای مغناطیسی است که از حساسیت بالای مغناطیس آنها به میدان مغناطیسی، پاسخ سریع و اتلاف کم توان در این مواد استفاده می‌شود. سیم‌های مغناطیسی آمورف کبالت-پایه

مگنتوتنگش نزدیک صفر دارند. علت توجه بسیار به مواد دارای مگنتوتنگش صفر آن است که متحنی‌های مغناطش در این حالت تقریباً برگشتپذیر است. تلاش‌هایی برای مشاهده اثر مقاومت مغناطیسی در سیم‌ها و نوارهای آمورف کمالت‌پایه انجام دادیم.

در فصل دوم به معرفی مواد فرومغناطیسی، پادفرومغناطیسی و به شکل گستردۀ‌تر مواد مغناطیسی نرم پرداخته می‌شود.

در فصل سوم ابتدا مفهوم مقاومت مغناطیسی را معرفی می‌کنیم و بعد به تفصیل به اثر GMR می‌پردازیم. سپس میدان بایاس تبادلی و پارامترهای مهم در ساختار دریچه اسپینی بیان می‌شود. در پایان، کاربرد اثر GMR در حافظه مغناطیسی MRAM و حسگر میدان مغناطیسی آورده می‌شود.

فصل چهارم زمینه اطلاعاتی برای بخش تجربی سیم و نوار آمورف را فراهم می‌کند. با تعریف امپدانس و اندوکتانس مغناطیسی شروع می‌شود و با خلاصه تعدادی از مقالاتی که در جریان آزمایش‌ها مؤثر بودند پایان می‌یابد.

در بخش‌های اول و دوم فصل پنجم، نتایج آزمایش‌های انجام شده بر نوار و سیم آمورف و تلاش‌های انجام شده برای تفکیک مقاومت خالص از داده‌های ac ارائه می‌شود. در بخش سوم به روش ساخت و لایه‌نمانی نمونه‌های چندلایه مغناطیسی و آزمایش‌های انجام شده بر آنها می‌پردازیم. در پایان نکاتی را برای ادامه کار ارائه می‌دهیم.

فصل دوم

خواص مغناطیسی و مواد مغناطیسی نرم

در این فصل پس از معرفی مفاهیم فرومغناطیس، پادفرومغناطیس و پارامترهای مغناطیسی به ویژگی‌های مواد مغناطیسی نرم می‌پردازیم و در پایان، تاریخچه‌ای از مواد مغناطیسی نرم جدید بیان می‌شود.

۱-۲- فرومغناطیس و پادفرومغناطیس

منشأ مغناطیس، اسپین ذاتی و ممان‌های مغناطیسی مداری الکترون است. الکترون‌ها ذرات با اسپین $1/2$ هستند و مکانیک کوانتمی بیان می‌کند که ممان مغناطیسی اسپین روی هر محور دلخواه می‌تواند فقط دو تصویر "بالا" و "پایین" داشته باشد در نتیجه هر الکtron غیرجفت شده در اتم به اندازه یک مگتون بوهر^۱، μ_B ، در ممان مغناطیسی کل اتم، سهم دارد. اما چگونه می‌توان این مفهوم مغناطیسی را به یک ماده حجمی تعمیم داد؟ به این پرسش بعد از معرفی مفاهیم فرومغناطیس و پادفرومغناطیس می‌پردازیم.

ماده فرومغناطیسی ماده‌ای است که در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، ممان مغناطیسی خودبخودی^۲ دارد. به این ممان، ممان اشباع^۳ نیز گفته می‌شود و بدین مفهوم است که اسپین الکترون‌ها و ممان‌های مغناطیسی به صورت منظم قرار گرفته‌اند. هرچند چینش‌های^۴ کاملاً پیچیده‌ای می‌توانند به ممان‌های خودبخودی بیان‌جامند، یک فرومغناطیس ساده‌ترین چیش را دارد و در آن همه ممان‌های مغناطیسی موازی هم قرار گرفته‌اند. این چینش در نتیجه یک برهمکنش داخلی معروف به برهمکنش تبادلی^۵ است، خاصیتی که با مغناطش یا ممان مغناطیسی در واحد حجم ماده متناسب است. در مقابل، پادفرومغناطیس ماده‌ای است که

¹ $\mu_B = 0.927 \times 10^{-23} \text{ J/T}$

² spontaneous

³ Saturation moment

⁴ arrangement

⁵ Exchange field